

Präzise Powell-Linse, 45° Auffächerungswinkel, AR-Beschichtung 500-850 nm



Produkt **#70-142** **1 In Stock**

- 1 + €325^{,00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-10	€325,00 stückpreis
Stk. 11-49	€292,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

i Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Beam Shaping Lens **Typ:**

Physikalische und mechanische Eigenschaften

8.90 +0.00/-0.15 **Größe (mm):**

8.90 +0.00/-2.00 **Höhe (mm):**

Eingangsstrahldurchmesser, $1/e^2$ (mm):

1.3

Optische Eigenschaften

N-SF6

Substrat:

BBAR (500-850nm)

Beschichtung:

500 - 850

Wellenlängenbereich (nm):

Beschichtungsspezifikation:
 $R_{\text{abs}} < 1.0\% @ 500 - 700\text{nm}$
 $R_{\text{abs}} < 1.5\% @ 700 - 850\text{nm}$

1.458

Brechungsindex (n_d):

45.00

Auffächerungswinkel (°):

Konformität mit Standards

[Anzeigen](#)

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- Erzeugen gleichförmige Flat-Top-Profile über die gesamte Linie
- Auffächerungswinkel von 1° bis 75° verfügbar
- AR-Beschichtung für 400-500 nm oder 500-850 nm

Präzise Powell-Linsen, auch asphärische Liniengeneratoren genannt, weiten einen Eingangsstrahl mit einem bestimmten Auffächerungswinkel zu einer gleichförmigen Linie mit einem Flat-Top-Profil auf. Die Powell-Linsen werden in einem hochpräzisen Fertigungsprozess hergestellt, um eine hohe enthaltene Leistung, Gleichförmigkeit und Geradlinigkeit über die gesamte Produktlinie sowie hervorragende Konsistenz von Produkt zu Produkt sicherzustellen. Die Linsen sind für einen bestimmten Eingangstrahldurchmesser ausgelegt und bieten bei diesem Durchmesser beste Liniengleichförmigkeit, größere Eingangsstrahlen erzeugen eine höhere Intensität an den Rändern der erzeugten Linie, kleinere Strahlen erzeugen eine eher gaußförmige Verteilung. Präzise Powell-Linsen sind ideal für den Einsatz in der industriellen Bildverarbeitung und in Life-Science-Anwendungen inklusive 3D-Profilmessungen, PCB-Inspektion, Linienscan-SD-OCT, Linienscan-Konfokalmikroskopie, Durchflussszytometrie und Partikelanalyse.